

Таким образом, по результатам данной работы можно утверждать, что пьезоэлектрический кристалл $LiNbO_3$ является эффективным радиатором для преобразования энергии электронов в энергию излученных фотонов и может быть применен для исследования воздействия акустических волн на характеристики излучения канализированных заряженных частиц.

Список литературы

- [1] Каплин В.В., Плотников С.В., Воробьев С.А. // ЖТФ. 1980. Т. 50. № 5. С. 1079–1081.
- [2] Мкртчян А.Р., Гаспарян Р.А., Габриелян Р.Г. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. С. 432–436.
- [3] Авакян Р.О. и др. Препринт ЕФИ-779(6)-85, Ереван, 1985. 12 с.
- [4] Авакян Р.О. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 48. В. 11. С. 577–580.

Поступило в Редакцию
2 июня 1989 г.
В окончательной редакции
20 января 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 9 12 мая 1990 г.

06.2; 07; 12

© 1990

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА В $AlGaAs$ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВОРАЗМЕРНЫМИ СЛОЯМИ МЕТОДОМ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА

В.М. Андреев, В.Р. Ларионов,
А.М. Минтаиров, Т.А. Пруцких,
В.Д. Румянцев, К.Е. Смекалин,
В.П. Хвостиков

Полупроводниковые гетероструктуры (ГС) с ультратонкими (50–500 Å) слоями являются в настоящее время основой для создания целого класса приборов полупроводниковой опто- и микроэлектроники: полупроводниковых гетеролазеров, коротковолновых фотоприемников, транзисторов с высокой подвижностью электронов и т.п. [1]. При разработке и совершенствовании технологии создания таких ГС возникает проблема контроля электрофизических параметров ультратонких слоев. Весьма перспективным для решения этой про-

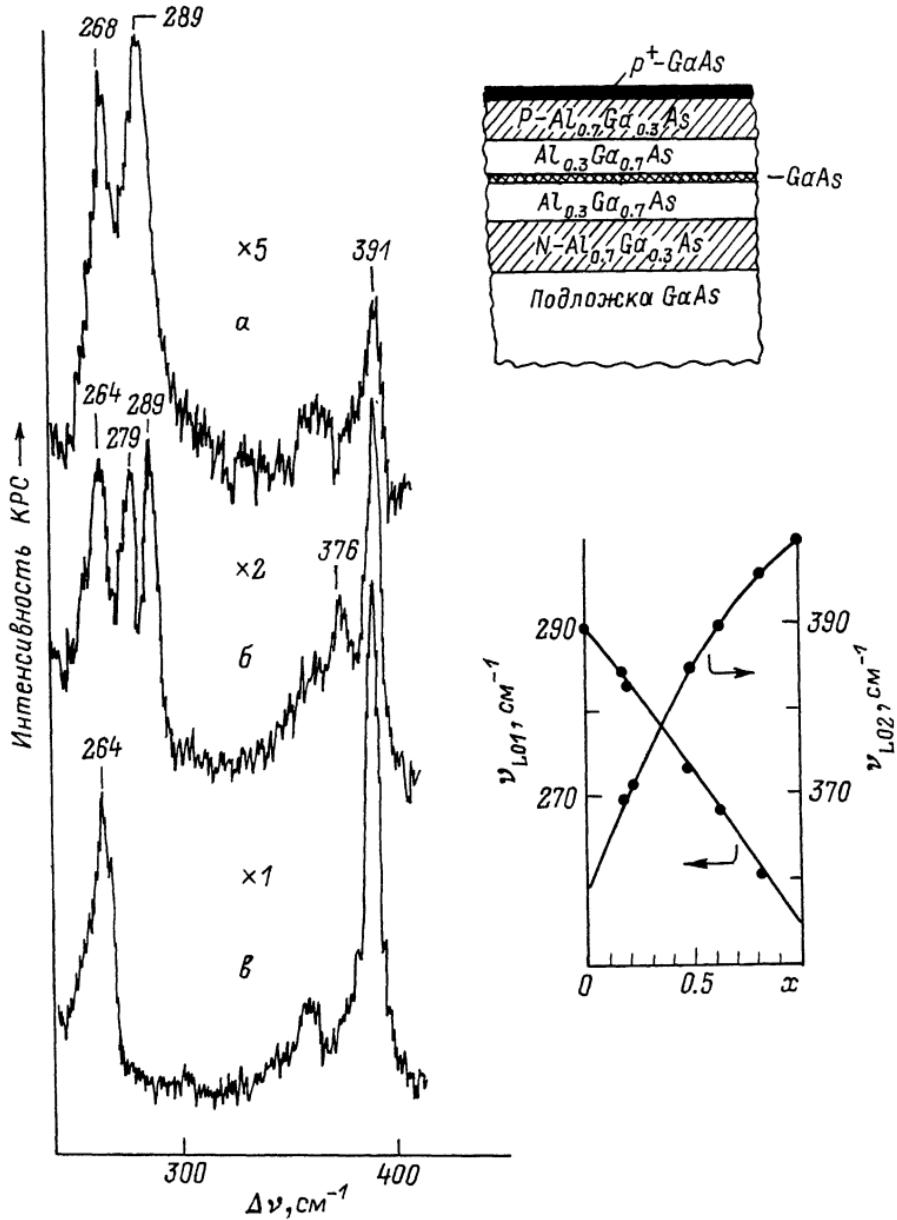


Рис. 1. Спектры КР, полученные при различных глубинах проникновения окисла D , мкм: а - 0, б - 1.13 и в - 1.30. Вставка вверху: схема расположения слоев исследуемой ГС инжекционного лазера. Вставка внизу: зависимость частот LO фононов $\text{Al}_x \text{Ga}_{1-x} \text{As}$ от состава x . Точки - данные эксперимента; сплошные кривые - расчет в модели [6].

блемы является метод, основанный на анализе спектров комбинационного рассеяния (КР) света, который характеризуется высокой чувствительностью и универсальностью и позволяет получать информацию о слоях ГС толщиной в десятки ангстрем [2, 3].

В настоящей работе приводятся результаты исследования возможности использования метода КР для измерения профиля распределения $AlAs$ по толщине многослойных $Al_xGa_{1-x}As$ гетероструктур с ультратонкими слоями на примере ГС инжекционных лазеров.

Исследовалась лазерная ГС с раздельным оптическим и электронным ограничением, схематически изображенная на верхней вставке рис. 1. Структура была выращена методом низкотемпературной ЖФЭ [4] на n^+GaAs подложке с ориентацией <100> и содержала буферный слой (на рис. 1 объединен с подложкой), слой широкозонного эмиттера $n-AlGaAs$, два нелегированных волноводных слоя $AlGaAs$, окружающих квантоворазмерную активную область $GaAs$, второй широкозонный эмиттер $p-AlGaAs$ и контактный слой p^+GaAs . Образцы лазеров с контактами, изготовленные из данной структуры, в режиме генерации излучали на длине волны 830 нм при плотности порогового тока 360 A/cm^2 ($T = 300 \text{ K}$).

Методика измерения профиля распределения $AlAs$ по толщине ГС состояла в ступенчатом анодном окислении образца и анализе спектров КР, содержащих сигналы от различных слоев. Анодное окисление проводилось в водном растворе лимонной кислоты, аммиака и этиленгликоля. Глубина проникновения окисла в слой $AlGaAs$ прямо пропорциональна величине приложенного анодного напряжения, а приращение глубины составляет по данным профилометрических измерений $13.6 \pm 0.8 \text{ \AA/V}$ и не зависит от доли $AlAs$. Образец послойно окислялся до глубины примерно 0.15 мкм, затем окисел стравливался в смеси изопропилового спирта и ортофосфорной кислоты и проводился новый цикл окисления. Площадь окисляемого участка на поверхности образца составляла $3-4 \text{ mm}^2$.

Спектры КР снимались на двойном монохроматоре ДФС-52 в 90° градусной геометрии рассеяния в поляризации $z(xy)\bar{z}$, где $x - [010]$, $y - [001]$, $z - [100]$; при возбуждении Ar^+ -лазером на длине волны 5145 Å и мощностью 150 мВт. Луч лазера был сфокусирован на образце до диаметра 50 мкм. Спектры снимались в диапазоне $200-420 \text{ cm}^{-1}$ с шагом 0.5 cm^{-1} при ширине щели монохроматоров 3 cm^{-1} . Согласно правилам отбора [5], при выбранной геометрии рассеяния для соединений со структурой цинковой обманки в спектрах КР разрешены только линии рассеяния на продольных оптических (LO) фононах.

Для определения доли $AlAs$ в слоях ГС использовалась зависимость частот двух фононов $LO_1(\Gamma)$ и $LO_2(\Gamma)$ $Al_xGa_{1-x}As$ от x [3]. Результаты измерений частот LO-фононов, выполненных на калибровочных образцах, и расчетов, выполненных в теоретической модели [6], приведены на нижней вставке рис. 1. Как видно из рисунка, при увеличении содержания $AlAs$ в диапазоне $X=0-1$

частота $\text{LO}_1(\Gamma)$ -фонона монотонно уменьшается от 290 до 254 см⁻¹ тогда как частота $\text{LO}_2(\Gamma)$ -фонона монотонно увеличивается от 360 до 400 см⁻¹. Среднее изменение частот составляет 40 см⁻¹. Считая, что точность измерения положения максимумов линий в спектре КР составляет половину ширины аппаратной функции спектрометра и учитывая, что используются две линии фононов, получил для точности определения содержания AlAs величину ± 2 мол.%.

Анализировалась зависимость частоты и интенсивности линий LO-фононов в спектрах КР от глубины проникновения окисла при последовательном переводе в окисел всех слоев ГС. До окисления (рис. 1,а) в спектре наблюдаются линии, соответствующие сильнолегированному поверхностному контактному слою $\rho^+ \text{GaAs} - 268$ и 289 см⁻¹ [7]. Остальные слои ГС в этом случае, кроме ближайшего к поверхности второго широкозонного эмиттера (слабая линия 391 см⁻¹), не наблюдаются из-за сильного поглощения возбуждающего излучения в контактном слое. По мере окисления в спектре начинают проявляться линии, соответствующие более глубоколежащим слоям. Когда граница окисла достигает активной области (рис. 1,б), удается наблюдать линии сразу трех слоев: активной области (289 см⁻¹), первого (со стороны подложки) волноводного слоя (279 и 376 см⁻¹) и первого широкозонного эмиттера. При этом линии LO₁(Г)-фононов всех трех слоев, включая и квантоворазмерную активную область толщиной 200 Å, хорошо разрешены и имеют достаточную для регистрации интенсивность. Конечный спектр КР, соответствующий случаю, когда окислены все слои, кроме первого широкозонного эмиттера, приведен на рис. 1, в и содержит только линии LO-фононов $\text{Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{As}$ (264 и 391 см⁻¹).

Для восстановления информации об исходных толщинах слоев ГС была построена зависимость относительных интенсивностей линий фононов различных слоев от глубины проникновения окисла, которая приведена на рис. 2,а. Здесь верхние и нижние границы слоев фиксируются, когда интенсивность соответствующих линий (кривые 1-6) выходит на максимальное и нулевое значения. Например, для контактного слоя интенсивность линий (кривая 1) максимальна до начала процесса окисления и принимает нулевое значение при глубине проникновения окисла 0.3 мкм, равной толщине этого слоя. При этом интенсивность линий следующего слоя – второго эмиттера (кривая 2) проходит через максимум и т.д. Точность определения глубины залегания границ слоев определяется шагом увеличения глубины проникновения окисла и ограничена минимальной толщиной, при которой может быть зарегистрирован сигнал КР. Для используемых экспериментальных условий предельная точность составляет 40 Å. Для квантоворазмерной активной области было получено значение толщины 200 \pm 20 Å. Остальные слои имели следующие толщины: второй эмиттер – 0.7 мкм, слои волновода по 0.05 мкм.

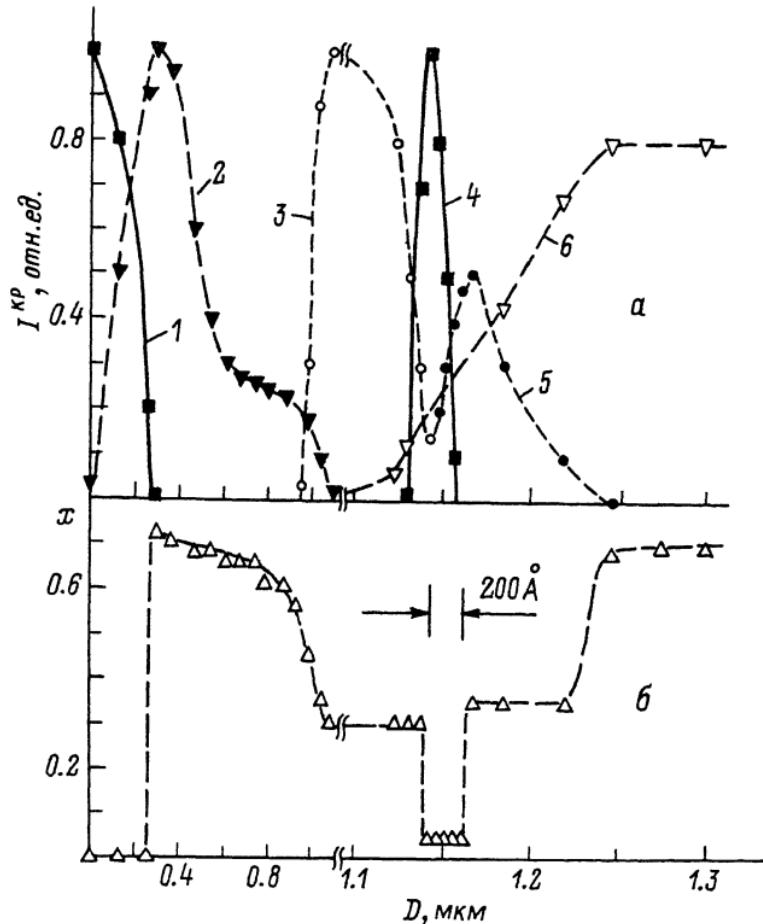


Рис. 2. а) Зависимость относительной интенсивности линий фоновых от глубины проникновения окисла D для различных слоев ГС: 1 – контактного слоя, 2 – второго эмиттера, 3 – второго волноводного слоя, 4 – активной области, 5 – первого волноводного слоя, 6 – первого эмиттера. б) Экспериментально полученное распределение $AlAs$ по толщине исследуемой ГС.

Результатирующее распределение $AlAs$ по толщине исходной ГС, отсчитываемой от поверхности (рис. 2,б), полученное с помощью данных о составах слоев, показало, что в исследованной структуре второй широкозонный эмиттер имеет градиент концентрации $AlAs$ (30 мол. %/мкм). Имеется также заметный переходный слой между этим эмиттером и вторым волноводным слоем (~ 0.1 мкм), обусловленный, по-видимому, процессом замены расплавов перед началом роста широкозонного эмиттера. Кроме того, волноводные слои различаются по составу на величину $\Delta x = 0.05$.

Таким образом, проведенные исследования показали, что метод комбинационного рассеяния света при послойном анодном окислении позволяет с высокой точностью измерять распределение $AlAs$ по толщине многослойных $AlGaAs$ -гетероструктур с ультратонкими ($\gtrsim 50$ Å) слоями.

Список литературы

- [1] Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры / Под ред. Л. Ченга и К. Плога. М.: Мир, 1989. С. 462-546.
- [2] A b s t r e i t e r G., B a u s e r E., F i s c h e r A., P l o o g K. // Appl. Phys. 1978. V. 16. N 4. P. 345-352.
- [3] А н д�еев В.М., М интагиров А.М., Н ахимович М.В., С мекалин К.Е., Р умянцев В.Д., Х в остиков В.П., Я кимов А.Ю. Тез. докл. 1 Всес. конф. по физич. основам твердотельной электроники, т. В, Л., 1989. С. 102-103.
- [4] А лферов Ж.И., А ндреев В.М., Конников С.Г., Л арионов В.Р., П огребицкий К.Ю., Х в остиков В.П. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 2. С. 171-176.
- [5] Рассеяние света в твердых телах / Под ред. М. Кардоны и Г. Гюнтеродта, т. 2. М.: Мир, 1984. С. 65-71.
- [6] C h e m g Y., J a w D., J o u M., S t r i n g f e l l o w G. // J. Appl. Phys. 1989. V. 65. N 8. P. 3285-3288.
- [7] F u k a s a w a R., W a k a k i M., O h t a K., O k u m u r a H. // Jpn. J. Appl. Phys. 1986. V. 25. N 3. P. 652-653.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
20 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 9

12 мая 1990 г.

06.3; 07; 12

© 1990

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВНЫХ СВЕТОВОДОВ,
ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ Er^{3+} В КАЧЕСТВЕ
СОЛИТОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ

А.Б. Г р у д и н и н, Д.В. К о р о б к и н

В экспериментах [1] был осуществлен квазистационарный режим распространения сверхкоротких импульсов (СКИ) света на длине волны 1.6 мкм благодаря компенсации оптических потерь за счет ВКР-усиления сигнального излучения. Использование непре-